

平成26年度 予算配分

運営費配分	H26配分額	H25配分額	
材料・デバイス室(WN11)	10,045,000	11,547,000	円
光・バイオ室(WN12)	490,000	564,000	
機械・ロボット室(WN13)	39,800	43,000	
運営(WN01)	4,072,000	4,681,300	
	計	14,646,800	16,835,300
		(-13%)	
設備維持費配分(別紙参照)			
材料・デバイス室(WN11)	8,104,000	4,929,000	
機械・ロボット室(WN13)	480,000	385,000	
	計	8,584,000	5,314,000

平成26年度 支出案

WN11 -> WN01 980,663円

支出	運営費	人件費(1人)	1,300	千円
		年報・パンフレット	200	
		コピー機、プリンター関連	200	
		ソフトウェア等パソコン関連	100	
		事務用品	123	
		謝金(産学官連携DAY、スーパーユーザ)	200	
		SVBL棟保守・点検・修理、設備維持支援	549	
		空調機保守点検	300	
		電気代	1,100	
		計	4,072	

別紙1-2b

部局等名: 研究設備センター(先端研究設備部門)

【平成26年度】

No.	事項名(設備名)	基準積算額(千円)	配分希望額(千円)	設備管理者氏名	予算詳細
1	電子ビーム露光	549	549	野崎 眞次	WN11
2	多機能オプトエレクトロニクス デバイス作製・研究設 備(SVBL)	3,970	3,970	野崎 眞次	WN11
3	有機金属気相成長 (MOCVD)装置	1,114	1,114	野崎 眞次	WN11
4	ウェットステーション	647	647	野崎 眞次	WN11
5	ナノ微細加工と3Dマ イクロ加工設備	2,304	1,824	野崎 眞次	WN11
			480	青山 尚之	WN13
	合計	8,584	8,584		

※1. 基準積算額の合計と配分希望額の合計を一致させてください。

※2. 「設備使用実績」欄は、これまでの設備の使用状況や維持運営費の使用用途、及び今年度の予定など配分希望額の根拠